

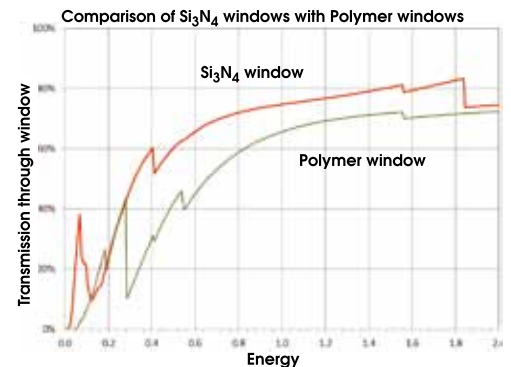


- 优异的工业设计
- 配合扫描电子显微镜使用的高性能SDD能谱仪
- 最优化低能端X射线的透过率，提高X射线的使用效率
- 全新的 APEX™ 软件，智能化、流程化、简易操作
- 为工业客户提供最快、最优异的分析结果
- 最先进、低噪音的电子学系统

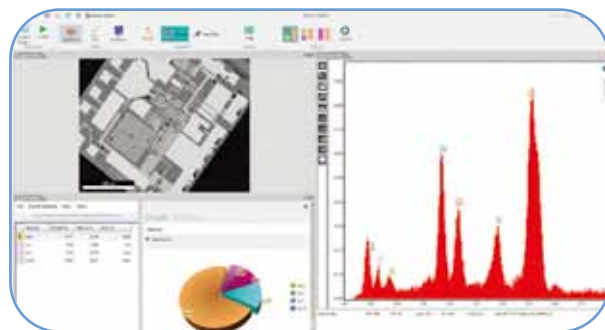
Element硅漂移探测器（SDD）系列封装紧凑，具有强大的分析能力，可将性能和灵活性提升到最高水平，与此同时，流水线操作可确保快速获取结果和易用性。为工业市场特殊设计，确保分析过程快速精确。Element电制冷能谱仪配合简易操作的APEX™软件能够让所有的分析和质量检测过程变得高效智能，满足所有行业的应用。

Element 电制冷能谱

- 优异的能量分辨率
- 图谱，定量分析、点分析、线扫描、面分布和自定义报告可供使用
- Si₃N₄窗口最大化提高轻元素及低能端X射线的透过率
- 先进的低噪音电子设备，可实现卓越的通过能力
- 优异的几何学设计提高数据收集效率



APEX™ 软件



EDAX公司的能谱仪系统全面升级的APEX™操作分析软件，界面友好，操作简单，智能高效。APEX™软件简化组分分析并提供更高效的数据收集能力，且保证结果的精确和可靠性。软件的用户界面可以根据不同的客户进行定制，为每一类客户提供一套个性化的工作流程，提供更多的报告模板。

特性

- 芯片有效面积 - 30 mm²
- Si₃N₄ 窗口
- 129 eV 能量分辨率 @ Mn K
- 真空密封封装模块
- X射线输入计数率 > 1M cps
- X射线输出计数率 > 500kcps
- 峰背比 > 10,000/1
- 稳定的分辨率
- 元素探测范围: Be - Am
- 帕尔帖半导体制冷 (无需风扇和液氮)
- 固定或移动滑轨可选

优势

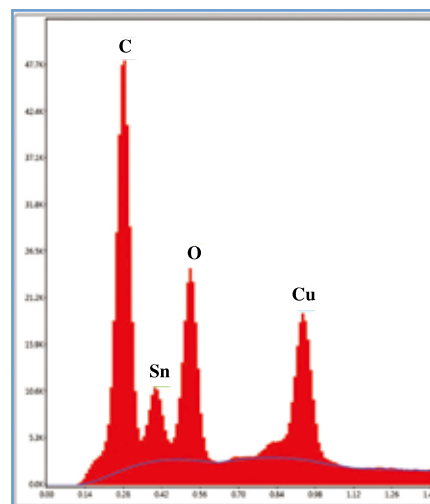
出色的轻元素结果和最佳的低能量表现

- 在5 kV 加速电压下，对印刷电路板的横截面样品进行测试。在 C K 和 O K 峰之间能清晰地看到外延层中 Sn M 线的谱线

Si₃N₄窗口可靠性

- 在电制冷SDD能谱仪中配合使用Si₃N₄ 窗口，利用该窗口材料的稳定性和提升的透过率表现能为能谱的应用带来最优异和可靠的结果。独特的模块设计可以

使探头防腐蚀以及防机械振动，Element能谱仪可以适配于等离子体清洗。



结论

Element 能谱分析系统可以提供强大的分析能力和市场领先的性能。先进的工业设计，新窗口Si₃N₄材料的使用，操作和分析软件全面升级都带来了性能的飞跃。能够为用户提供最智能、最快速、最精确、最稳定的分析结果。

APEX™ 软件选项

特性	标配
基本分析	✓
数据管理和报告	✓
智能定量	✓
线扫描	✓
多点分析	✓
智能触控	✓
谱线监测	✓
EDS CPS 面扫描	✓
定量重建	✓
自动面扫描	✓
自动谱图显示	✓
EDS 高级线扫描	Option
定量面扫描 及重建	Option
高级报告	Option
谱图匹配	Option
自动材料数据库	Option